

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 1 区分

【発行日】平成25年12月26日 (2013.12.26)

【公開番号】特開2011-123067(P2011-123067A)

【公開日】平成23年6月23日 (2011.6.23)

【年通号数】公開・登録公報2011-025

【出願番号】特願2010-272532(P2010-272532)

【国際特許分類】

G 0 1 N 35/10 (2006.01)

C 1 2 Q 1/68 (2006.01)

C 1 2 M 1/00 (2006.01)

【F I】

G 0 1 N 35/06 E

C 1 2 Q 1/68 A

C 1 2 M 1/00 A

【手続補正書】

【提出日】平成25年11月7日 (2013.11.7)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

流体サンプル中に存在し得る分析対象物を自動分析器において単離かつ分析する方法であって、該方法が、自動化された、

a) サンプル区画においてサンプルをサンプル容器からマルチウェル・プレートへと移し換える段階と、

b) 前記マルチウェル・プレートのウェル内において、前記分析対象物が固体支持物質上に固定化されるのを許容するに十分な時的間隔及び条件下で、前記固体支持物質及び前記流体サンプルを相互に組み合わせる段階と、

c) 分離ステーションにおいて、前記流体サンプル中に存在する他の物質から前記固体支持物質を単離する段階と、

d) 前記分離ステーションにおいて、前記固体支持物質から前記流体サンプルを分離し且つ前記物質を洗浄用緩衝液により一回以上洗浄することにより、前記分析対象物を精製する段階と、

e) 増幅区画において前記分析対象物を分析する段階と、を含み、

段階 b) から段階 d) は、第 1 空気流を有する前記自動分析器の処理区画において実施されると共に、段階 e) は第 2 空気流を有する前記自動分析器の前記増幅区画において実施され、

前記第 1 空気流及び前記第 2 空気流は分離され、且つ、

前記サンプル区画は、前記処理区画の前記第 1 空気流及び前記増幅区画の前記第 2 空気流とは別体的である空気流を有する方法。

【請求項 2】

前記処理区画は第 1 空気圧を備えて成り、且つ、前記増幅区画は第 2 空気圧を備えて成り、前記第 1 空気圧は前記第 2 空気圧よりも大きい請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

前記サンプル区画は第 3 空気圧を備えて成り、前記処理区画の前記第 1 空気圧及び前記

サンプル区画の前記第 3 空気圧は、略同一である請求項 2 に記載の方法。

【請求項 4】

前記処理区画に進入する外気は濾過される請求項 3 に記載の方法。

【請求項 5】

前記処理区画及び増幅区画は壁部により分離される請求項 3 又は 4 に記載の方法。

【請求項 6】

精製された前記分析対象物は、前記処理区画及び増幅区画の間に配置されたエアロックを通して、前記処理区画から前記増幅区画へと移送される請求項 3 から 5 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 7】

前記自動分析器は、前部側に、操作器システムのための前記サンプル区画及び前記処理区画に対するアクセスを許容するように移動可能な壁部を有する請求項 1 から 6 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 8】

分析対象物を単離して精製する分離デバイスを有する処理区画であって、第 1 空気流を有する処理区画と、

反応容器中に収容された前記分析対象物を分析する分析区画であって、第 2 空気流を有する分析区画と、

サンプルをサンプル容器から処理容器へと移し換えるサンプル区画であって、第 3 空気流を有するサンプル区画と、

精製された前記分析対象物を含む容器を前記処理区画から前記分析区画へと移送する移送システムと、を具備し、

前記処理区画における前記第 1 空気流と、前記分析区画における前記第 2 空気流と、前記サンプル区画における前記第 3 空気流とが別体的である、

分析対象物を処理する自動分析装置。

【請求項 9】

前記処理区画は第 1 空気圧を備えて成り、且つ、前記分析区画は第 2 空気圧を備えて成り、前記第 1 空気圧は前記第 2 空気圧よりも大きい請求項 8 に記載の自動分析装置。

【請求項 10】

前記サンプル区画は第 3 空気圧を備えて成り、前記処理区画の前記第 1 空気圧及び前記サンプル区画の前記第 3 空気圧は、略同一である請求項 9 に記載の自動分析装置。

【請求項 11】

前記処理区画と前記分析区画との間にはエアロックが配置される請求項 8 又は 10 に記載の自動分析装置。

【請求項 12】

当該自動分析装置は前記各区画の間に配置された分離壁を具備する請求項 8 から 11 のいずれか一項に記載の自動分析装置。

【請求項 13】

前記サンプル区画は、該サンプル区画内で流れる空気の濾過のためのフィルタを有する請求項 8 から 12 のいずれか一項に記載の自動分析装置。

【請求項 14】

前記移送システムは、前記反応容器を前記処理区画から前記エアロックへと移送する第 1 操作器と、前記反応容器を前記エアロックから前記分析区画へと移送する第 2 操作器とを有する請求項 8 から 13 のいずれか一項に記載の自動分析装置。

【請求項 15】

当該自動分析装置は、前部側に、操作器システムのための前記サンプル区画及び前記処理区画に対するアクセスを許容するように移動可能な壁部を有する請求項 8 から 14 のいずれか一項に記載の自動分析装置。